第五章 結論與建議

本文結論如下:

- 1. NF₃、SF₆於正常操作下減少清潔時間,其產品在 AOI 及良率的表現與未 減少清潔時間前比較並無太大差異。
- 2. 縮短清潔或反應時間20~40秒,假設一個月不停機條件下,則上述四台設備,一年可減少使用量546,120公升,節省成本約885萬元,若全廠進行減量,則減量幅度相當可觀,如表5.1。

	农 3.1 湘州 7 州 3 11 3 11 6 成 里来正长				
機台	清潔時間	氣體種類	用量	用量	每年減少使
	(sec)		(公升/月)	(公升/年)	用量(公升)
CVD1	370	NF ₃	123,400	1,480,800	81,600
	350	NF ₃	116,600	1,399,200	
CVD2	260	NF ₃	69,120	829,440	126,720
	220	NF ₃	58,560	702,720	
CVD3	260	NF ₃	75,600	907,200	138,600
	220	= NF ₃	64,050	768,600	
CVD4	230	SF ₆	191,600	2,299,200	199,200
	210	SF ₆	715,000	2,100,000	

表 5.1 縮短清潔時間對 NF3、SF6減量彙整表

3. 對於NF3的處理效率,B Local Scrubber>99.6%,但 A Local Scrubber僅為78.0%~83.3%。對於SF6的處理效率, D Local Scrubber為94.3%~96.4%,但 C Local Scrubber 卻僅有42.3%,如表5.2。

表 5.2 處理效率彙整表

Local	氣體	NF3或SF ₆	去除效率%
Scrubber 設備	種類	使用率	
A	NF_3	99.1%	78.0~83.3%
В	NF_3	98.7%	99.6%
С	SF_6	85.3%	42.3%
D	SF ₆	53.8%	94.3%

原因初步分析可能有:

- (1)加熱裂解溫度不夠高。
- (2)尾氣停留於加熱區的時間不足。

- (3)水洗吸收效果不良。
- (4)機台設備不稳定。
- (5)Local Scrubber 端通入空氣量多寡。
- 4.製程機台對 clean gas—NF $_3$ 的使用率為 99.1%及 98.7% 皆遠高於聯合國 IPCC 公告之 Tier 2b method 設定參數值(CVD 製程中 NF $_3$ 的 C_i 設定值為 80%),有助於降低廠內 PFC 的排放推估量。
- 5. 製程機台對 process gas SF_6 的使用率則為 84.9% 及 53.8%,兩者的差異是 否來自於製程機台之 plasma power 的強度,則須進一步確認。不論如何 皆高於聯合國 IPCC 公告之 Tier 2b method 設定參數值(Dry Etch 製程中 SF_6 的 C_i 設定值為 50%),亦有助於降低廠內 PFC 的排放推估量。



本文研究建議如下:

- 1. 減少清潔秒數後,持續觀察壓力變化曲線是否符合 Clean 之安全規格,並 觀察 AOI 對 Yield 的影響。
- 2. 本次量測結果發現,製程尾氣中含有高濃度具毒性及腐蝕性的氣體 (如 F₂、Cl₂、SiF₄、SiCl₄、HF、HCl...等),建議工程師 PM 或更換管路時 應佩戴適當之防護設備(如呼吸防護具、防護衣、防酸手套等),以降低管 路或設備機台內殘存之有害氣體及微粒對 PM 人員健康危害的風險。
- 3. 為減少 SiH₄被 trapped 於 powder 內造成拆卸管路發生爆管,以及腐蝕性物質、powder 累積造成管路的腐蝕阻塞問題,建議除減少管路轉折及纏加熱帶外,可選擇側吹氮氣之雙層管路或以加熱之氮氣直接 purge 管路。
- 4. 針對廠務風管阻塞問題,建議要求 Local Scrubber 設備商改善其對微粒的 去除效率(如加裝微粒去除設備等),或重新評估其它型式之 Local Scrubber。
- 5. A Local Scrubber 量測去除效率結果為 5 chember > 4 chember > 3 chember,與一般量測多 chember 數去除效率小於少 chember 數不同,建議是否朝風量調整、機台穩定性進一步進行探討。
- 6.對於 C Local Scrubber 處理效率僅 42.3%,建議調整此設備及其他相同設備 之操作參數(如提高加熱溫度、更換洗滌吸收液或提高換水次數)並提高維 修保養頻率及次數,以提高處理效率。